

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年1月5日(2006.1.5)

【公表番号】特表2005-505681(P2005-505681A)

【公表日】平成17年2月24日(2005.2.24)

【年通号数】公開・登録公報2005-008

【出願番号】特願2003-536360(P2003-536360)

【国際特許分類】

C 10 M 175/00 (2006.01)

C 10 N 70/00 (2006.01)

【F I】

C 10 M 175/00

C 10 N 70:00

【手続補正書】

【提出日】平成17年9月15日(2005.9.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項8

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項8】

工程(b)及び(d)で使用される触媒が、第VIB族金属、第VIIC族非貴金属及び耐火性酸化物支持体を含む同じ触媒である請求項5~7のいずれか1項に記載の方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項10

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項10】

少なくとも工程(a)~(b)が、工程(a)及び(b)を行うために多数の触媒積重ね床を有する1つの反応器で行われ、かつガス及び液体は、触媒と接触する時、向流で流れる請求項1~4のいずれか1項に記載の方法。